Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

/ INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT

(use as many sheets as necessary)

3

Sheet

Complete if Known				
Application Number	Based on 09/678,656			
Filing Date	October 4, 2000			
First Named Inventor	Toshimitsu KONUMA			
Group Art Unit	2871			
Examiner Name	Huyen Le Ngo			
Attorney Docket Number	0756-7221			

				U.S. PATENT DOCUMENT	rs	
Examiner Initials	Cite No.1	U.S. Patent Document		Name of Patentee or Applicant of Cited	Date of Publication of Cited Document	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear
		Number	Kind Code ² (If known)	Document	MM-DD-YYYY	
#10		4,239,345		Berreman et al.	12/16/80	
		4,272,162		Togashi et al.	06/09/81	
		5,258,135		Uchida et al.	11/02/93	
		5,637,672		Rieger et al.	06/10/97	
		5,462,621		Ishii	10/31/95	
		5,298,297		Takei	03/29/94	
		5,250,214		Kanemoto et al.	10/15/93	
		5,189,535		Mochizuki et al.	02/23/93	
		5,172,255		Brosig et al.	12/15/92	
		4,508,427		Ross	04/02/85	
		5,005,952		Clark et al.	04/09/91	
1/		5,495,355		Konuma	02/27/96	
V \		4,492,432		Kaufmann et al.	01/08/85	,
M		5,995,185		Konuma	11/30/99	

			F	OREIGN PATENT DOC	UMENTS		
Examiner Initials	Cite No.	1		Date of Publication of Cited			
		Office	Kind Code ² Number ⁴ (if krigwn)	Applicant of Cited Document	MM-DD-YYYY	Figures Appear	Τ⁴
HP		JP	03-158823 🗸		07/08/91		Full
		JP	63-298220 √		12/06/88		Abst.
		JP	56-164320 🗸		12/17/81		Abst.
W		JP	03-031821		02/12/91		Abst.
417		JP	01-204025 ✓		08/16/89		Abst.
H			OTHER PRIOR	ART - NON PATENT LITE	RATURE DOCUMENTS		
Examiner Initials	Cite No.1			hor (in CAPITAL LETTERS), i ournal, serial, symposium, catalo publisher, city and/or count	og, etc.)., date, page(s), volum		T²
#N		Matumoto et al., "New Hybrid-Aligned Nematic Multicolor Liquid-Crystal Display," Oyo Buturi, Vol. 45, No. 1, pp. 853-856, 1976.					

Examiner Date n / c /	
Examiner Date 7/1/1/1	
Signature Considered 4/6/8	<i>l</i>

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 2.0 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Office, Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

Please type a plus sign (+) inside this box \rightarrow [+]

PTO/SB/08A (08-00)

^{*}EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

¹ Unique citation designation number. ² See attached Kinds of U.S. Patent Documents. ³ Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ⁴ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ⁵ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁶ Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

¹Unique citation designation number. ² Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

Approved for un

ough 10/31/2002. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

	for form 1449A/PTO	***************************************			iplete	f Known		
TATEO	73 A 4 77 T (Application Nun		7 E 30	1	Based on 09/678,656 728932		
	RMATION I	Filing Date	10		31	October 4, 2000		
STAT	EMENT BY	First Named In	entor	2006	ध	Toshimitsu KONUMA		
	(use as many sheets t	Group Art Unit	AUE	2 5 200	ii)	2871		
				Examiner Name	<u> </u>		₹/	Huyen Le Ngo
Sheet	ı	of	3	Attorney Docket	Number	TO TRADE	7	0756-7221

				U.S. PATENT DOCUMENT	rs	
Examiner Initials	Cite No.1	U.S. Patent Document		Name of Patentee or Applicant of Cited	Date of Publication of Cited Document MM-DD-YYYY	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear
. 1		Number	Kind Code ² (if known)	Document	Document Rest-DD-1111	
1/1/		4,239,345		Berreman et al.	12/16/80	
	-	4,272,162		Togashi et al.	06/09/81	
		5,258,135		Uchida et al.	11/02/93	
	\vdash	5,637,672		Rieger et al.	06/10/97	
 		5,462,621		Ishii	10/31/95	
		5,298,297		Takei	03/29/94	
		5,250,214		Kanemoto et al.	10/15/93-10/5/93	
 	 	5,189,535		Mochizuki et al.	02/23/93	
		5,172,255		Brosig et al.	12/15/92	
 	 	4,508,427		Ross	04/02/85	
 	\vdash	5,005,952		Clark et al.	04/09/91	
1	 	5,495,355		Konuma	02/27/96	
1 4/	 	4,492,432		Kaufmann et al.	01/08/85	
- M	-	5,995,185	-	Konuma	11/30/99	

				OREIGN PATENT DOC	UMENTS		
Examiner Initials*	Che No.	Foreign Patent Document		Name of Patentee or	Date of Publication of Cited Document	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant	74
1		Office	Kind Code ² Number ⁴ ((f known)	Applicant of Cited Document	MM-DD-YYYY	Figures Appear	1
The	+	JР	03-158823		07/08/91		Full
1117	\vdash	JP .	63-298220		12/06/88		Abst.
	 	JP	56-164320		12/17/81	X	Abst.
	+	-JP	03-031821		02/12/91		Abst.
1	 	JP	01-204025		08/16/89	4	Abst.
37.5			OTHER PRIO	R ART – NON PATENT LITE	RATURE DOCUMENTS		
Examiner Initials	Cite No. ¹		item (book, magazine,	athor (in CAPITAL LETTERS), journal, serial, symposium, catal publisher, city and/or coun	og, etc.)., date, page(s), volum try where published.	e-issue number(s),	T²
		Mat But	umoto et al., "New F uri, Vol. 45, No. 1, p	lybrid-Aligned Nemati p. 853-856, 1976.	c Multicolor Liquid-	Crystal Display," Oyo	

Signature *EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with perticommunication to applicant.

Date

Considered

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 2.0 hours to complete. Time will vary depending upon the need Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Of Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



Examiner

¹ Unique citation designation number. ² See attached Kinds of U.S. Patent Documents. ³ Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ⁴ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ³ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁶ Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

¹Unique citation designation number. ² Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached

LIQUID CRYSTAL HANDBOOK

Edited by Liquid Crystal Handbook Editors Commission Maruzen Co., Ltd. Published on October 30, 2000

2.5.2 alignment condition

- a. analyzing method of alignment phenomena
- (i) examination method with respect to alignment structure
- (1) examination method of pretilt angle
- (a) crystal rotation method 1): On the assumption that the liquid crystal molecules are aligned uniformly in the antiparallel cell, the pretilt angle θ_0 can be obtained in a means similar to measurement of dielectric principal axis in crystal optics. Dependency of transmitting light amount on angles is measured with putting a sample between perpendicular polarizers and rotating the sample around an axis perpendicular to the rubbing axis. An example is shown in Fig. 2. 405. θ_0 is obtained by applying data to a theoretical equation after the refractive index of the liquid crystal is measured. This method is effective in the case of comparatively small value of θ_0 .
- b. alignment of nematic liquid crystal
- (i) alignemnt between substrates which have undergone an alignment treatment

Various kinds of alignment conditions as shown in Fig. 2. 414 can be formed by selecting a vertical alignment plane and a horizontal alignment plane between substrates, or by changing direction of horizontal alignment treatment. The vector of liquid crystal alignment is varied continuously among different alignement planes. A vertical alignment condition is referred as "homogeneous" or "planar", and a horizontal alignment condition is referred as "homeotropic". A hybrid alignment can be realized by combining a vertical alignment plane and a horizontal alignment plane. Further, inclination alignment, which is an intermediate condition of horizontal alignment and vertical alignment, can be realized, and referred to as π alignment in the case that rising directions are different. In case of changing the horizontal alignment direction is varied, twist alignment can be realized. Combined with twist force of liquid crystal itself, super twist alignment with twist an angle of over 180° can be realized.

液晶便覧

液晶便寬編集委員会 編

丸善株式会社

液晶便覧

平成12年10月30日 発 行

編 者 液晶便寬編集委員会

発行者 村田誠四郎

免行所 丸磨株式会社

出版事業部

〒103-8245 東京都中央区日本橋二丁目 3 香10号 編集部 電話(03) 3272-0511/FAX(03) 3272-0527 官業部 電話(03) 3272-0521/FAX(03) 3272-0693 URL:http://www.maruzen.co.jp/home/pub/top.html

郵便振替口座 00170-5-5

⑥ 液晶便覧編集委員会,2000

组版印刷·中央印刷株式会社/製本·株式会社松岳社

ISBN 4-621-04798-1 C3058

Printed in Japan

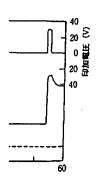
を実現することができ

うことでチルトリバース ことから、プレチルト角 いることがわかる。

ハた液晶表示素子の性 向膜のみ・ポリイミド イミド LB 膜両方を配 類の TN 液晶素子の印)である。3種類の液晶 :し、ポリイミドLB腹 !を使用した場合と同等

で定化強誘電性液晶 こいる。SSFLCでの配 性を保つことである。 ことは困難な場合が多 ・世性液品の自発分極に 化したイオンが形成す





ドLK膜を用いた ′配向膜を用いた

δ電場により応答した分子の一部が戻る現象があげられ -ている。この現象は配向膜上のイオンの電荷を電極に逃 がすことで防止できる。ポリイミド LB 膜は通常数十 mmからなる通常のポリイミド膜に比べて厚みが薄く、 電荷が表面から電極に移動しやすい。図 2.403 に配向膜 としてポリイミド LB 膜を用いた SSFLC(図(a))と, 通常のラピング配向膜を用いた SSFLC (図(b)) の光 掌応答を示す。通常のラピング配向腹の場合。メモリー 性が一部失われているが、ポリイミド LB 膜の場合、杏 _{き込み後}の透過光の変化がなくメモリー性が保たれてい

以上,代表的なノンラビング配向方法について述べ た. はじめにも述べた通りラピングプロセスは簡便かつ 確実な方法であり、すでに工程上の問題は解決されてい **る。そのため、今後開発される新たな配向方法には、配** p分割の容易さ、薄膜形成のしやすさなどのディスプレ 4の特性を向上させる付加価値が求められる.

引用文献

- 1) D. C. Flanders, D. C. Shaver, and H. I. Smith, Appl. Phys. Lett., 32(10), 597 (1978).
- 2) A. Sugiura, N. Yamamoto, and T. Kawamura, Jpn. J. Appl. Phys., 20(7), 1343 (1981).
- 3) 戸田清、渡辺典子、竹本敏夫、中村功、シャープ技 \$1. 39. 67 (1988).
- 4) Y. Kawata, K. Takatoh, M. Hasegawa, and M. Sakamoto, Liq. Cryst., 16(6), 1027 (1994).
- 5) M. Schadt, K. Schmitt, V. Kozinkov, and V. Chigrinov, Jpn. J. Appl. Phys., 31(7), 2155 (1992).
- 6) 叙村靖文, 小林俊介, 応用物理, 64(10), 1007 (1995).
- 7) 長谷川雅樹、第4回コロイド・界面実用課座液晶ディス プレイと表面・界面制御の最新技術 (日本化学会), 1(1996).
- 8) M. Hasegawa and Y. Taira, Proc. IDRC 94, 213 (1994).
- 9) M. Hasegawa, H. Takano, A. Takenaka, Y. Momoi, K. Nakayama, and A. Lien, SID 96 Digest, 666 (1996).
- 10) H. Hashimoto, T. Sugiura, K. Kato, T. Saito, H. Suzuki, Y. Iimura, and S. Kobayashi, *Proc. SID 95*, 26, 877 (1995).
- 11) Y. limura, T. Saito, S. Kobayashi, and T. Hashimoto, J. Photopolym. Sci. Technol., 8, 257 (1995).
- 12) 橫本 微,加藤一久,飯村靖文,小林駿介,第 22 回液晶 計論会予稿集。167 (1996).
- M. Schadt and H. Seiberle, SID 97 Digest, 397 (1997).
- 14) M. Schadt, H. Seiberle, and A. Schuster, Nature, 381, 212 (1996).
- 15) 西片康成,森川敦司,滝口廣之,金本明彦,鈴木正明。 柿本雅明,今井淑夫,日化誌,1987(11),2174。
- 16) M. Suzuki, M. Kakimoto, T. Konishi, Y. Imai, M. Iwamoto, and T. Hino, Chem. Lett., 1986, 395.
- 17) M. Kakimoto, M. Suzuki, T. Konishi, Y. Imai, M. Iwamoto, and T. Hino, Chem. Lett., 1986, 823.
- l8) H. Ikeno, A. Oh-saki, N. Ozaki, M. Nitta, K. Nakaya, and S. Kobayashi, SID 88 Digest, 45 (1988).

- 19) M. Murata, H. Awaji, M. Isurugi, M. Uekita, and Y. Tawada, Jpn. J. Appl. Phys., 31, L 189 (1992).
- 20) M. Murata, M. Uekita, Y. Nakajima, and K. Saitoh, Jpn. J. Appl. Phys., 32, L 679 (1993).
- 21) M. Murata, M. Uckita, Y. Nakajima, and Saitoh, Jpn. J. Appl. Phys., 32, L 679 (1993).
- 22) H. Mochizuki, M. Yamamoto, H. Satani, M. Murata, and M. Uekita, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 206, 93 (1991).
- 23) H. Ikeno, A. Oh-saki, M. Nitta, K. Nakaya, and S. Kobayashi, SID 88 Digest, 45 (1988).
- 24) H. Ikeno, A. Oh-saki, M. Nitta, N. Ozaki, Y. Yokoyama, K. Nakaya, and S. Kobayashi, Jpn. J. Appl. Phys., 27 (4), L 475 (1988).
- 25) Y. Nishikawa, A. Morikawa, Y. Takiguchi, A. Kanemoto, M. Kakimoto, and Y. Imai, Jpn. J. Appl. Phys., 27(7), L 1163 (1988).

[高頭孝毅]

2.5.2 配向状態

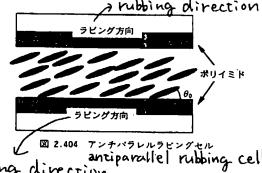
2.5 配 向

a. 配向現象の解析法

前項では液晶を配向させる具体的な方法論について述 べてきた。ここではネマチック液晶の配向評価を中心に 関連する方法論についてまとめる.

- (i) 配向構造に関する評価法
- (1) プレチルト角の評価法:各種配向法によって得 られた基板を用いてセルを組み上げると、垂直配向や水 平配向とは若干異なる配向状態を示すことが多い。たと えばラビング(水平)配向処理を施した基板をアンチバ ラレルに組むと、図 2.404 に示すように一様に傾いた配 向状態を示す. ここで, 分子がどの程度傾いて配向して いるか、いわゆるプレチルト角 品は、各種 LCD 駆動法 の最適化とも関連して非常に重要なパラメーターであ る。液晶分子を複屈折媒体とみなして誘電率の主軸方向 の分布を決めるという考え方に立脚すれば、プレチルト 角は構造パラメーターの一つに過ぎない。しかし、一軸 配向を誘起する基板を簡単に評価する方法として,プレ チルト角を求める意味は大きい。簡便な測定法として以 下の方法が考案されている.

(a) クリスタルローテーション法":図 2.404 に示



antiparallel rubbing cell rubbing direction



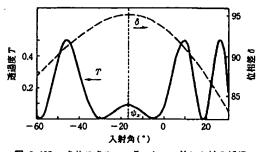


図 2.405 クリスタルローテーション法における透過 光強度と位相差の入射角依存性

[T. J. Scheffer and J. Nehring, J. Appl. Phys., 48, 1783 (1977)]

すアンチパラレルセル中で液晶分子が一様に配列してい るとすると、傾き角 & は結晶光学における誘電主軸の 測定と同様な手法で求めることができる。 直交する偏光 子の間に試料を入れ、ラビング軸に対して垂直な軸の周 りに試料を回転し、透過光量の角度依存性を測定する。 図 2.405 に一例を示す。 あらかじめ液晶の屈折率を測定 しておき、データを理論式にあてはめて ぬを求める. 6. が比較的小さい場合に有効である。

(b) 磁場容量零位法1: 先のクリスタルローテーシ ョン法と同様、セル内で一様に傾斜配向した試料を準備 する. フレデリクス転移しきい値以上の磁場中 (B> Bc)で試料を回転させ、静電容量の変化を測定する。 図 2.406(a) に示すように、 & の方向に磁場を印加して も磁場無印加時の容量 C_0 と同じである。 heta > heta の方向 に印加すると容量は増加する (図(b))、磁場を必要と するわずらわしさはあるが、ゐの方向におおむね制限 がない (精度は 品=45 がもっとも高い). 静電容量測 定の代わりに、位相測定を行うことによっても同様の計

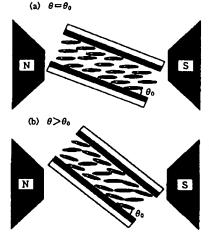
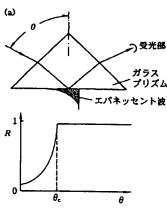


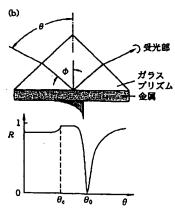
図 2.406 磁場容量零位法におけるセ ル回転角と液晶配向

測が可能である.

(2) 全反射減衰法および表面プラズモン法型:屈 折率の高い媒質 ng から低い媒質 nl へ光が入射すると き, 入射角が臨界角 &(=sin-1n1/nH) を超えると全反 射が生じることはよく知られている (図 2.407(a)), 既 知の高屈折率プリズムを用いることで、未知媒体の屈折 率を知ることができる。また、反射にさいして波長程度 の光の場が界面から低複屈折側にしみ出していることか ら、異方性も含めて屈折率既知の媒質に対しては、表面 でのプレチルト角の測定や電場や磁場を印加したときの 配向変化を調べることができる。

表面プラズモン法 (図(b)) も界面近傍の液晶配向を 調べる手法として有用である。ガラスと液晶の間に金 銀などの数十 nm 程度の金属薄膜が存在すると、ガラ





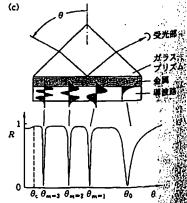


図 2.407 エパネッセント波を用いた光学配置および反射光の角度依存性

- (b) クレッチマン配置を用いた表面プラズモン励起法 (a) 全反射減衰法
- (c) 導波路を併用した表面プラズモン励起法

ス-金属界面に表面で 表面プラスモンとは? る TM 電磁波であり たとき、その波数べく を励起する条件を満り 反射光強度の極小を 6界面近傍の液品の) 折率が既知である場合 議論することができ、 セルにおける表面プ ここでは、反対側のよ 目を果しているため、 落ち込みが観測され、 方向の構造金般によ・ ン共鳴による界面近仁 全体の厚さ方向の配し だし、ここで議論する かじめ構造の概略やタ の理論計算などによん

- (3) 分光学を用い
- (a) IR (赤外分 光素子技術とデータ 度が非常に上がって 2.4.6頃にまとめられ 光の特徴はいうまで て配向を議論するこ 向膜や液晶化合物の 平均的にどの方向をし 化学に馴染みやすく・ 報としてはもっとも。 の実験を選ばないの 晶/基板界面を直接き 間分解機能や顕微機は

赤外分光の入射角・ たポリイミド配向膜 ロメリットイミド), を示すり、図 2.408(; に固定し, y 軸の周 強度を測定する。芳 とC=O逆対称仲縮 を図(b) に示す. 既 ユニットにおき,そ のようにおく、

 $f(\theta,\phi) \approx F \exp i$

245

(a) (b)

0.8 1 c10^gC⁻¹) :るアンカリン り :O 斜め洗着基:場合。

I. Appl. Phys.,

して外挿長が伸び、アン こがわかる。

Dる"湖れ転移"現象に 5 表面秩序と配向現象の 更験的には主として透過 (エリプソノトリー)が で測定した表面誘起複屈 :解析することにより、 - ターを求めることがです。

\+ラビング処理とSiO

15° 5CB on HTAB 快光子

の測定例

(°C)

u., 43, 51 (1979)}

:面供達パラ	ノー	9-
表面程序	文	献
()	1)	1
0.20	1))
0.27	2))
0.005	2))

-0.05

Lett., 43, 51 (1979). rashi, and H. Kamei, Appl.

3)

1. Phys. Rev. Lett., 67, 2033

料め蒸着膜の比較であろう。前者はバルクに近い表面秩序パラメーターをもっているにもかかわらず、SiO 斜め蒸着ではほとんどみられない。このことは PVA ラピング膜は界面自身に分子配向制御力があるのに対して、SiO 膜自身は微視的な配向制御力をもたないことを意味する。SiO 膜の配向規制力は膜面形状と弾性変形を組み合わせたマクロな要因であるとも考えられるが、むしら、液晶性入時の流れに起因した液晶吸着層の微小な異方性によるとする説もある。

引用文献

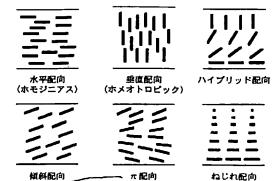
- 1) T. J. Scheffer and J. Nehring, J. Appl. Phys., 48, 1783 (1977).
- 2) W. Knoll, MRS Bulletin., 16, 29 (1991).
- 3) F. Yang, J. R. Sambles, and G. W. Bradberry, "The Optics of Thermotropic Liquid Crystals", ed. by S. Elston and R. Sambles, Taylor and Francis (1998), p. 85.
- 4) 末高 洽ら、"表面赤外およびラマン分光"、アイピーシー (1990)。
- 5) K. Sakamoto, R. Arafune, N. Ito, S. Ushioda, Y. Suzuki, and S. Morokawa, J. Appl. Phys., 80, 431 (1996).
- 6) Y. R. Shen, Liq. Cryst., 5, 635 (1989).
- X. Zhuang, L. Marrucci, and Y. R. Shen, Phys. Rev. Lett., 73, 1513 (1994).
- H. Yokoyama, "Handbook of Liquid Crystal Research" ed by P. J. Collings and J. S. Patel, Oxford University Press (1997), p. 179.
- J. C. Dubois, M. Gazard, and A. Zann, J. Appl. Phys., 47, 1270 (1976).
- H. Yokoyama, S. Kobayashi, and H. Kamei, J. Appl. Phys., 61, 4501 (1987).
- 11) H. Yokoyama, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 165, 265 (1988).
- 12) K. Miyano, Phys. Rev. Lett., 43, 51 (1979).

[大内幸雄]

b. ネマチック液晶の配向

ネマチック液晶の配向ベクトルは分子単位で急変することはなく、目視できる程度の大きな範囲で連続的に変化している。ネマチック液晶の配向に影響を与える因子としては、液晶と境界を接している固体表面、電場や磁場などの外的な因子と、ネマチック液晶自身がもっているわじれ(ツイスト)力など内的な因子があげられる。と(に外的因子が配向に与える影響は非常に大きい。ラピング処理など配向処理を施した固体表面上のネマチック液晶では、界面の影響が非常に大きく配向ベクトルがそろった均一な配向状態を示す、界面近傍の液晶分子は固定されて動かない(強アンカリング)とされ、この強アンカリングにより可逆的な電気光学効果が実現できる。

(i) 配向処理した基板間での配向 基板間で,垂 ^{直配向面}と水平配向面を選択,または水平配向処理の方



ア alignment 均一配向処理基板間.

向を変えることで、図2.414のようなさまざまな配向状態をつくり出すことができる。液晶配向ベクトルは異なる配向面間で連続的に変化している。水平配向状態はホモジニアスまたはプレーナー、垂直配向状態はホメオトロピックとよばれる。垂直配向面と水平配向面を組み合わせたハイブリッド配向も可能である。さらに水平配向と垂直配向の中間になる傾斜配向も実現でき。立ち上がり方向が異なる場合 π (パイ) 配向とよばれる。基板間で水平配向方向を変化させた場合。ねじれ(ツイスト)配向が実現できる。液晶自身のねじれ力をあわせると、180 以上のねじれ角をもたせたスーパーツイスト配向も可能となる。

- (ii) 転傾(ディスクリネーション) しかし、均一な配向処理をしない、または配向ベクトルを乱す因子がある場合、配向ベクトルが不連続な変化を起こすことがある。配向ベクトルの急変を転傾(ディスクリネーション、disclination)¹⁾という。この転傾は、図2.415のような、液晶を偏光顕微鏡下で観察した場合にみられる特有の組織(テクスチャー、texture)の原因となる。
- (1) 転傾の分類:転傾は線状欠陥 (line disclination) と点状欠陥 (point disclination) に分けられる。

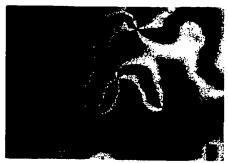


図 2.415 ネマチック液晶の偏光顕微鏡写真

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Остига

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.